

SEMICON[®] JAPAN

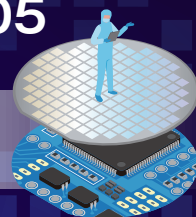
開催日 12/17(水)~19(金)

時間 10:00~17:00

場所 東京ビッグサイト

CKDブース 南1ホール S1505

半導体市場を支えるファインシステム機器



集積化ガス供給システム
IAGD

エアオペレイトバルブ
AGD (高温・高耐久)

流量診断ユニット
TPB

レギュレータ
PGM

Gas-Facilities

Gas Supply

Gas-Vacuum process

Deposition

Ion Implantation

Etching

圧力制御システム
IAVB

エアオペレイトバルブ
AVB

比例制御システム
VEC-R

GAS control
VACUUM control

エアオペレイトバルブ
AMD※※3R

エアオペレイトバルブ (マニュアル)
GAMD※※3R

エアオペレイトバルブ (メタルレス)
AMD※1M

マニュアルバルブ
MMD※03RN

Chemical-Facilities

Chemical Supply

Chemical process

Cleaning

Resist Coating

CMP

電動流量調整バルブ
MNV

パイロット式レギュレータ
PMP

ファインレベルスイッチ
KML

CHEMICAL control

1980年代から「蓄積してきた技術力」「コア部品の一貫生産へのこだわり」「徹底した製造工程の管理」で長きにわたり半導体製造プロセスの高精度化、歩留まり向上に貢献して参りました。

生産性の向上

直動式3ポート弁 3QRシリーズ

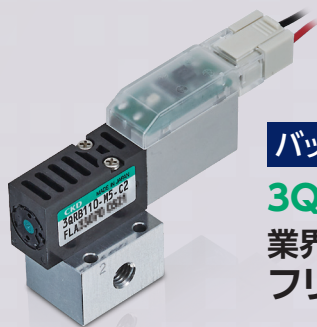
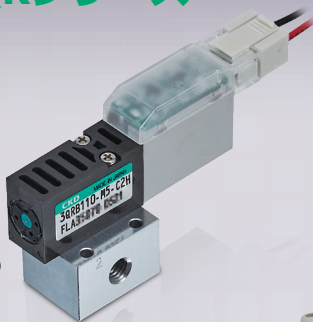
高速塗布・選別用

3QR 高応答仕様

業界最高レベル

応答時間ON: 2 ± 0.5 ms

(JIS B 8419: 2010 動的性能試験による初期値)



バッテリー駆動・連続通電用

3QR フリー電源仕様

業界初

フリー電源ソレノイド

高応答タイプDDモータ HD-4 シリーズ

高タクト動作を追求した、
高応答タイプの新モデル



バルブの誤動作防止用

インターロック機能付

MN3/4E0・MN3/4E00シリーズ

個別給電・遮断によるインターロック機能を実装

アドバンスドパッケージ向け高速三次元検査装置

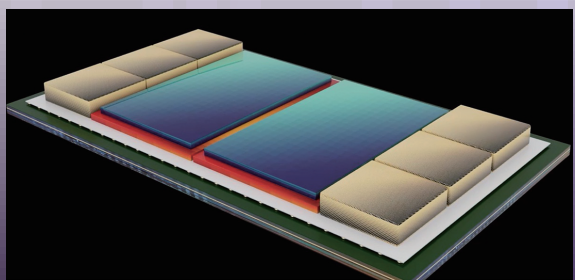
【測定例】 マイクロバンプ高さ、Cuピラー、ウェハー・基板の歪み、異物

特長

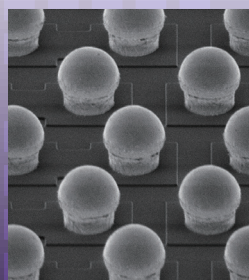


- CKD独自 (特許) の光学系を用いて
高速な測定: 32WPH
- 高解像度: 水平分解能 $1\mu\text{m}$
- 対応規格: SEMI S2, S8, CE

測定例



- マイクロバンプ高さ
- Cuピラー



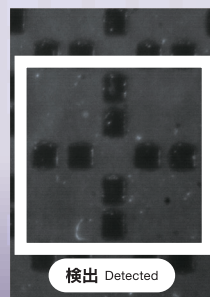
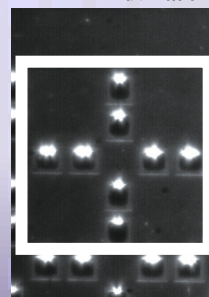
- ウェハー、基板の歪み
- 異物

新しい透明体検査装置

【測定例】 フラックス検査、TGV検査

フラックス検査

検査結果 Inspection Result

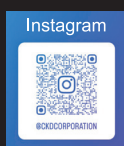


検出 Detected

TGV検査



半導体前工程から、中後工程まで、CKDのトータル技術力で皆様の課題解決のヒントが見つかりますので、お気軽にブースへお立ち寄りください。



CKD株式会社

機器事業本部
販売促進部

〒485-8551 愛知県小牧市応時二丁目250番地

<https://www.ckd.co.jp/> TEL: (0568) -74-1304